

## 747180-2025 - Resultados

**España – Maquinaria y aparatos microelectrónicos – Adquisición de un equipo de implantación de iones por inmersión en plasma (PIII)**

**OJ S 217/2025 11/11/2025**

**Anuncio de adjudicación de contrato o concesión. Régimen normal**

**Suministros**

### 1. Comprador

---

#### 1.1. Comprador

Denominación oficial: Rectorado de la Universitat Politècnica de València

Correo electrónico: [contratacion@upv.es](mailto:contratacion@upv.es)

Naturaleza jurídica del comprador: Organismo de Derecho público bajo el control de una autoridad regional

Actividad del poder adjudicador: Educación

### 2. Procedimiento

---

#### 2.1. Procedimiento

Título: Adquisición de un equipo de implantación de iones por inmersión en plasma (PIII)

Descripción: La técnica PIII consiste en la implantación precisa de iones dopantes (como boro, fósforo o arsénico) en materiales semiconductores. El NTC trabaja en concreto sobre la fabricación de dispositivos fotónicos y de momento no dispone de esta técnica ni de ninguna similar para realizar “dopajes” de los componentes que fabrica. Se trataría de implementar una nueva técnica permitiendo mejoras en la calidad y las características de los componentes fotónicos fabricados. El elemento principal de un componente fotónico es la guía de onda que se suele realizar sobre silicio (o nitrato de silicio) y esta técnica, al implantar iones de distintos materiales dentro de esas guías, permitiría modificar el índice de refracción del Silicio y mejorar sus propiedades. Como ejemplo de posible aplicación futura, el NTC dispondría de la capacidad de implantar materiales como el Erblio dentro de las guías de ondas en silicio para fabricar amplificadores ópticos integrados, que son esenciales en sistemas de comunicación por fibra óptica para compensar la pérdida de señal a largas distancias. Dado que la fotónica a menudo involucra materiales sensibles al calor, la capacidad de PIII para operar a bajas temperaturas es una gran ventaja, ya que evita daños térmicos en los dispositivos. Además, la técnica PIII es escalable y puede aplicarse a obleas grandes, lo que la hace adecuada para la producción en masa de dispositivos fotónicos. El NTC necesitaría un equipo PIII que permita procesar con obleas de diámetro de 8 pulgadas haciéndole compatible con los equipos que ha ido incorporando últimamente y que trabajan con obleas de este tamaño. Disponer de estas capacidades supondría una mejora importante a nivel interno del instituto y al mismo tiempo permitiría ofrecer un servicio más completo a usuarios externos, tanto grupos de investigación como empresas. Disponer de una herramienta que nos permite modificar las propiedades de las guías de ondas aumentaría los servicios ofertados, asegurando la calidad de estos. Asimismo, facilitaría el acceso por parte de los grupos de investigación del instituto a proyectos de investigación competitivos que se ve dificultada en la actualidad por la falta de este equipo. La infraestructura solicitada pondría las instalaciones del NTC en primer nivel tecnológico y a la par con centros punteros en fotónica y comunicaciones. Mejorar las capacidades de fabricación de circuitos ópticos con diferentes tipos de dopaje en obleas de hasta 8 pulgadas (compatible con fabricación en obleas de 6 pulgadas y muestras) supondría

una singularidad del NTC, que lo haría destacar a nivel europeo. En definitiva, la adquisición del equipamiento solicitado permitirá innovar las capacidades del instituto solicitante, posibilitando así continuar en la vanguardia de la fotónica en Europa, tanto en producción científica y fabricación de series importantes de circuitos fotónicos integrados como en transferencia tecnológica. La adquisición de este equipo DE IMPLANTACIÓN DE IONES POR INMERSIÓN EN PLASMA (PIII), está vinculado al proyecto “ICTS MICRONANOFABS- NTC- PLAN ESTRATEGICO 2021-2024” financiado por la concesión directa de subvención del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, según Real Decreto 714/2024, de 23 de julio. Esta subvención está financiada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión europea, establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19, y regulado según Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Identificador del procedimiento: c7a9843b-a695-4088-b50c-7a83d5055c2a

Anuncio anterior: 95b2662d-1585-407f-98b6-703f818e6d5e-01

Identificador interno: MY25/IUTNA/S/37

Tipo de procedimiento: Abierto

#### **2.1.1. Finalidad**

Naturaleza del contrato: Suministros

Clasificación principal (cpv): 31712100 Maquinaria y aparatos microelectrónicos

#### **2.1.2. Lugar de ejecución**

Subdivisión del país (NUTS): Valencia / València (ES523)

País: España

#### **2.1.4. Información general**

**Base jurídica:**

Directiva 2014/24/UE

## **5. Lote**

---

### **5.1. Lote: LOT-0000**

Título: Adquisición de un equipo de implantación de iones por inmersión en plasma (PIII)

Descripción: La técnica PIII consiste en la implantación precisa de iones dopantes (como boro, fósforo o arsénico) en materiales semiconductores. El NTC trabaja en concreto sobre la fabricación de dispositivos fotónicos y de momento no dispone de esta técnica ni de ninguna similar para realizar “dopajes” de los componentes que fabrica. Se trataría de implementar una nueva técnica permitiendo mejoras en la calidad y las características de los componentes fotónicos fabricados. El elemento principal de un componente fotónico es la guía de onda que se suele realizar sobre silicio (o nitruro de silicio) y esta técnica, al implantar iones de distintos materiales dentro de esas guías, permitiría modificar el índice de refracción del Silicio y mejorar sus propiedades. Como ejemplo de posible aplicación futura, el NTC dispondría de la capacidad de implantar materiales como el Erblio dentro de las guías de ondas en silicio para fabricar amplificadores ópticos integrados, que son esenciales en sistemas de comunicación por fibra óptica para compensar la pérdida de señal a largas distancias. Dado que la fotónica a menudo involucra materiales sensibles al calor, la capacidad de PIII para operar a bajas temperaturas es una gran ventaja, ya que evita daños térmicos en los dispositivos. Además, la técnica PIII es escalable y puede aplicarse a obleas grandes, lo que la hace adecuada para la producción en masa de dispositivos fotónicos. El NTC necesitaría un equipo PIII que

permita procesar con obleas de diámetro de 8 pulgadas haciéndole compatible con los equipos que ha ido incorporando últimamente y que trabajan con obleas de este tamaño. Disponer de estas capacidades supondría una mejora importante a nivel interno del instituto y al mismo tiempo permitiría ofrecer un servicio más completo a usuarios externos, tanto grupos de investigación como empresas. Disponer de una herramienta que nos permite modificar las propiedades de las guías de ondas aumentaría los servicios ofertados, asegurando la calidad de estos. Asimismo, facilitaría el acceso por parte de los grupos de investigación del instituto a proyectos de investigación competitivos que se ve dificultada en la actualidad por la falta de este equipo. La infraestructura solicitada pondría las instalaciones del NTC en primer nivel tecnológico y a la par con centros punteros en fotónica y comunicaciones. Mejorar las capacidades de fabricación de circuitos ópticos con diferentes tipos de dopaje en obleas de hasta 8 pulgadas (compatible con fabricación en obleas de 6 pulgadas y muestras) supondría una singularidad del NTC, que lo haría destacar a nivel europeo. En definitiva, la adquisición del equipamiento solicitado permitirá innovar las capacidades del instituto solicitante, posibilitando así continuar en la vanguardia de la fotónica en Europa, tanto en producción científica y fabricación de series importantes de circuitos fotónicos integrados como en transferencia tecnológica. La adquisición de este equipo DE IMPLANTACIÓN DE IONES POR INMERSIÓN EN PLASMA (PIII), está vinculado al proyecto "ICTS MICRONANOFABS- NTC- PLAN ESTRATEGICO 2021-2024" financiado por la concesión directa de subvención del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, según Real Decreto 714/2024, de 23 de julio. Esta subvención está financiada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión europea, establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19, y regulado según Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Identificador interno: MY25/IUTNA/S/37

#### **5.1.1. Finalidad**

Naturaleza del contrato: Suministros

Clasificación principal (cpv): 31712100 Maquinaria y aparatos microelectrónicos

#### **5.1.2. Lugar de ejecución**

Subdivisión del país (NUTS): Valencia / València (ES523)

País: España

#### **5.1.6. Información general**

Proyecto de contratación pública financiado total o parcialmente con fondos de la UE

La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no

#### **5.1.7. Contratación estratégica**

Objetivo de la contratación estratégica: Ninguna contratación estratégica

Enfoque para reducir el impacto ambiental: Otros

Objetivo social promovido: Otros

#### **5.1.10. Criterios de adjudicación**

**Criterio:**

Tipo: Precio

Descripción: Oferta económica.

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (puntos, exacto)

Criterio de adjudicación: número: 100,00

#### 5.1.15. Técnicas

**Acuerdo marco:**

Ningún acuerdo marco

**Información sobre el sistema dinámico de adquisición:**

Ningún sistema dinámico de adquisición

Subasta electrónica: no

#### 5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso: Rectorado de la Universitat

Politécnica de València - Universitat Politècnica de València

Información sobre los plazos de revisión: Advertir a los interesados que el presente acto pone fin a la vía administrativa. Contra el mismo se podrá interponer recurso Contencioso-

Administrativo ante el órgano jurisdiccional competente de lo Contencioso-Administrativo de la Comunidad Valenciana, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación de la presente Resolución. No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra esta resolución un recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso Contencioso-Administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta de recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 y sig. de la ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (BOE 2 de octubre de 2015). En los casos previstos en el artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, advertir a los interesados que esta resolución es definitiva en vía administrativa y contra la misma podrá interponerse potestativamente recurso especial en materia de contratación regulado en dicho artículo, ante el órgano de contratación de la Universitat politècnica de València. El plazo de interposición será de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto impugnado. En los supuestos de financiación por la U.E. (Fondos NEXT GENERATION), el plazo de interposición del recurso especial en materia de contratación, cuando proceda, será de 10 días naturales y se computará en la forma establecida en el artículo 50.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso:

Rectorado de la Universitat Politècnica de València - Servicio de Contratación. Edificio

Rectorado de la Universitat Politècnica de València

## 6. Resultados

---

Valor de todos los contratos adjudicados en este aviso: 589 900,00 EUR

#### 6.1. Resultados: identificador de lotes: LOT-0000

Estado de selección del ganador: Se ha escogido al menos un ganador.

#### 6.1.2. Información de los ganadores

**Ganador:**

Denominación oficial: Photon Export Thin Films & Patents SL

**Oferta:**

Identificador de la oferta: REF TEN-0001/LOT-0000

Identificador del lote o el grupo de lotes: LOT-0000

Valor de la licitación: 589 900,00 EUR

La oferta se ha posicionado: no

Subcontratación: No

**Información del contrato:**

Identificador del contrato: MY25/IUTNA/S/37

Fecha de elección del ganador: 15/10/2025  
Fecha de celebración del contrato: 06/11/2025

#### 6.1.4. Información estadística

##### **Ofertas o solicitudes de participación recibidas:**

Tipo de presentaciones recibidas: Ofertas de licitadores que son microempresas, pequeñas o medianas empresas

Número de ofertas o solicitudes de participación recibidas: 1

Tipo de presentaciones recibidas: Ofertas

Número de ofertas o solicitudes de participación recibidas: 1

##### **Gama de ofertas:**

Valor de la oferta más baja admisible: 589 900,00 EUR

Valor de la oferta más alta admisible: 589 900,00 EUR

## 8. Organizaciones

---

### 8.1. ORG-0001

Denominación oficial: Rectorado de la Universitat Politècnica de València

Número de registro: 40000260000071

Número de registro: Q4618002B

Localidad: Valencia

Código postal: 46022

Subdivisión del país (NUTS): Valencia / València (ES523)

País: España

Punto de contacto: Rectorado de la Universitat Politècnica de València

Correo electrónico: [contratacion@upv.es](mailto:contratacion@upv.es)

Teléfono: 963877406

Dirección de internet: <http://www.upv.es>

Perfil de comprador: <https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=zIBD30X0P3g%3D>

##### **Otros puntos de contacto:**

Denominación oficial: Servicio de Contratación. Edificio Rectorado de la Universitat Politècnica de València

Localidad: Valencia

Código postal: 46022

Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)

País: España

Dirección de internet: <https://www.upv.es/entidades/CYO/>

##### **Otros puntos de contacto:**

Denominación oficial: Universitat Politècnica de València

Localidad: Valencia

Código postal: 46022

Subdivisión del país (NUTS): Valencia / València (ES523)

País: España

Dirección de internet: <https://www.upv.es/entidades/CYO/>

##### **Funciones de esta organización:**

Comprador

Organización encargada de los procedimientos de recurso

Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso

### 8.1. ORG-0002

Denominación oficial: Photon Export Thin Films & Patents SL

Tamaño del operador económico: Microempresa, pequeña empresa o mediana empresa

Número de registro: B66785080

Localidad: esplugues de llobregat

Código postal: 08950

Subdivisión del país (NUTS): Barcelona (ES511)

País: España

Correo electrónico: [info@photonexport.com](mailto:info@photonexport.com)

Teléfono: +34 622375955

#### **Funciones de esta organización:**

Licitador

#### **Propietario beneficiario:**

Nacionalidad del titular: España

**Ganador de estos lotes: LOT-0000**

## Información del anuncio

---

Identificador/versión del anuncio: d6f3fb8f-932a-44c2-8ea8-ccb0504ce1c0 - 01

Tipo de formulario: Resultados

Tipo de anuncio: Anuncio de adjudicación de contrato o concesión. Régimen normal

Subtipo de anuncio: 29

Fecha de envío del anuncio: 10/11/2025 09:16:15 (UTC+01:00) Hora de Europa Central, hora de verano de Europa Occidental

Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente: español

Número de publicación del anuncio: 747180-2025

Número de la edición del DO S: 217/2025

Fecha de publicación: 11/11/2025